PUB-NO:

WO009610104A1

DOCUMENT-IDENTIFIER:

WO 9610104 A1

TITLE:

ELECTROLYTIC SOLUTION FOR

ELECTROLYTIC POLISHING AND

METHOD OF ELECTROLYTIC POLISHING

PUBN-DATE:

April 4, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OHMI, TADAHIRO

JΡ

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OHMI TADAHIRO

JΡ

APPL-NO:

JP09501957

APPL-DATE: September 27, 1995

PRIORITY-DATA: JP23119894A (September 27, 1994)

INT-CL (IPC): C25F003/16, C25F003/20 , C25F003/24

EUR-CL (EPC): C25F003/16

#### ABSTRACT:

A method of electrolytically polishing metals which are apt to form an oxide film, such as ferritic stainless steel or aluminum alloy, and an electrolytic solution therefor. The solution has a pH value of 6 to 10 and the dissolved oxygen has been purged with an inert gas or hydrogen.

### 世界知的所有権機関

## **PCT**

#### 国 際 事 務 局



# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

WO96/10104 (11) 国際公開番号 (51) 国際特許分類6 A1 C25F 3/16, 3/20, 3/24 1996年4月4日(04.04.96) (43) 国際公開日 PCT/JP95/01957 (21) 国際出願番号 1995年9月27日(27.09.95) (22) 国際出願日 (39) 優先権データ 1994年9月27日(27.09.94) JP 特顧平6/231198 (71) 出願人;および (72) 発明者 大見忠弘(OHMI, Tadahiro)[JP/JP] 〒980 宮城県仙台市青葉区米ケ袋2丁目1番17号301 Miyagi, (JP) (74) 代理人 弁理士 福森久夫(FUKUMORI, Hisso) 〒160 東京都新宿区本塩町12 Tokyo, (JP) (81) 指定国 US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 国際調查報告書 添付公開書類

- (54) TIGO: ELECTROLYTIC SOLUTION FOR ELECTROLYTIC POLISHING AND METHOD OF ELECTROLYTIC POLISHING
- (54) 発明の名称 電解研磨用電解液及び電解研磨法

#### (57) Abstract

A method of electrolytically polishing metals which are apt to form an oxide film, such as ferritic stainless steel or aluminum alloy, and an electrolytic solution therefor. The solution has a pH value of 6 to 10 and the dissolved oxygen has been purged with an inert gas or hydrogen.

### (57) 要約

本発明は、フェライト系ステンレス鋼やアルミニウム合金等酸化皮膜を形成し 易い金属の電解研磨方法及び電解研磨用電解液を提供することを目的とする。

PH6~10の電解質溶液であって、溶存する酸素を不活性ガスまたは水素ガスで置換したことを特徴とする。また、該電解研磨用電解液を用いて、金属を電解研磨することを特徴とする電解研磨法である。

## 

#### 明細書

## 電解研磨用電解液及び電解研磨法

## 5 技術分野

本発明は、電解研磨液及び電解研磨法に係わり、特にアルミニウムやフェライ ト系ステンレス鋼等酸化皮膜ができ易い金属の電解研磨方法に関する。

#### 背景技術

15

10 半導体集積回路の一層の高密度化、高機能化に伴い、その製造プロセス雰囲気 は更なる清浄化が要求され、用いられるガス、超純水等は一層の高純度化ととも に、成膜・処理室、ガス供給系、超純水供給系においても、耐食性が高く且つ不 純物の吸着の少ないものが求められている。

本発明者らは、ガス等の吸着が少なく、脱着特性に優れ、且つ耐食性に優れた 材料として、例えばオーステナイト系ステンレス鋼の表面を平滑化した後、弱酸 化性雰囲気中で酸化クロムからなる不動態膜を形成した材料を開発した。しかし ながら、様々な構造の装置、配管系を構成するには溶接が不可欠であり、これら ステンレス鋼の溶接部は、十分な酸化クロム膜が形成されず、溶接部において前 記特性が低下することが分かった。

20 そこで、更に材料及び不動態膜形成方法を検討した結果、フェライト系ステンレス鋼は溶接部でもクロム酸化膜の不動態膜が形成でき優れた脱ガス特性等が得られることが分かり、種々の形状、寸法の容器、配管を作製することが可能となった。しかしながら、オーステナイト系ステンレス鋼の場合には不動態膜形成前の平滑化手段として電解研磨法が非常に有効であるが、フェライト系ステンレス 25 鋼では従来の電解研磨法では電解研磨中に酸化皮膜が形成されて十分な平滑化がなされず、またその後に形成される不動態膜も十分な特性が得られなかった。

オーステナイト系ステンレス鋼の場合、通常、例えば燐酸系の溶液を用い 20V程度の電圧を印加して電解研磨を行うが、このような条件でフェライト系 ステンレス鋼を電解研磨すると、部分的に酸化皮膜が形成されて電解エッチング が起こり難くなったり、化学的なエッチングによる微細なクラックが発生したり する。またこのような酸化皮膜が形成されると酸化クロム不動態膜ができ難くな るという問題がある。

#### 発明の開示

本発明の電解研磨液は、PH6~10の電解質溶液であって、溶存する酸素を 10 不活性ガスまたは/及び水素ガスで置換したことを特徴とする。

前記電解質は、 $NaNO_3$ または $Na_2SO_4$ を含むのが好ましく、前記不活性ガスは窒素ガスであるのが好ましい。また、前記電解質溶液のPHは $6\sim8$ が好ましい。

本発明の電解研磨法は、上記電解液を用いて、金属を電解研磨することを特徴 とする。また、不活性ガス雰囲気中で行うのが好ましい。

本発明は、フェライト系ステンレス鋼またはAl (またはAl合金)に好適に 適用される。

#### 作用

25

20 被処理金属の化学的エッチングの起こらない弱酸性及び弱アルカリ性の電解質 溶液を用い、酸素ガスが発生しない電圧で電気分解させることにより、酸化膜の 形成を抑え平滑な金属表面を形成することが可能となる。

さらに、酸素ガスによる酸化を防止するために、電解液に溶解している酸素等  ${\rm ens}_2$  ガスや ${\rm H}_2$  ガスや ${\rm H}_2$  ガス等の非酸化性ガスで置換することにより、さらには電解質溶液を不活性ガス雰囲気に置き、より低い電圧で均一な電解研磨が達成され、平滑な金属表面が得られる。

本発明において、電解質溶液としては弱酸性あるいは弱アルカリ性の溶液が用いられ、PHとしては $6\sim1$ 0程度であり、 $6\sim8$ が好ましい。また、電解質は $NaNO_3$ :  $Na_2SO_4$ が好適に用いられる。

本発明電解研磨法は、酸化しやすい金属、合金等に対して有効であり、特にA1及びA1合金、フェライト系ステンレスに好適に適用されるものである。

## 発明を実施するための最良の形態

5 以下に実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明がこれら実施例 に限定されることはない。

#### (実施例1)

本実施例では表1の(A)に示す組成のフェライト系ステンレスを用いて電解 研磨を行った。

10 まず、 $N_2$ ガスに $H_2$ ガスを10%添加したガスで4.4mol/l $NaNO_3$ 溶液をバブリングして溶存する酸素ガスを取り除いた電解質溶液を準備した。

長さ $2\,\mathrm{m}$ 、外径3/8インチのステンレス管内部に、ワイヤーの陰極を挿入し、管内部に上記電解質溶液を流しながら電解電圧 $2\,0\,\mathrm{V}$ で電解研磨を行った。その後、超純水で洗浄し、 $N_2$ ガスで乾燥した。

続いて、酸化不動態膜形成装置に設置し、弱酸化性ガス(H<sub>2</sub>:10%、O<sub>2</sub>:5ppmを含むArガス)を流しながら、550℃で酸化して不動態膜を形成した。

#### (表1)

15

20 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | A | 0.0012 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 28.95 | 2.25 | 3.66 | 0.0023 | B | 0.0029 | 0.21 | 0.17 | 0.014 | 0.003 | 26.31 | 0.14 | 0.9 | 0.0049 | 25

#### (比較例1)

比較のため、電解質溶液として $15mol/1H_3PO_4$ 溶液を用い、電解電圧 10Vとした従来の方法でフェライト系ステンレス管の電解研磨を行い、その後 実施例1と同様にして酸化不動態膜を形成した。

実施例1及び比較例1の電解研磨後のステンレス管を切断し、内表面を顕微鏡 観察するとともに平滑度を測定した。

比較例1のステンレス管の平滑度R z は 0. 3  $\mu$  m程度であったのに対し、本実施例の平滑度R z は 0. 1  $\mu$  m と極めて優れた鏡面が得られた。また、比較例1 のスレンレス管の内表面には多数のクラックが観測されたが、本実施例のステンレス管では全く観測されなかった。

また、酸化膜形成後に管を切断し、内表面に形成された酸化膜の深さ方向の組成分布をESCAで分析したところ、実施例1のステンレス管はいずれも全面にわたり $Cr_2O_3$ からなる不動態膜が形成されていることが確認された。一方、比較例の1のステンレス管では、 $Fe_2O_3$ からなる酸化膜、 $Cr_2O_3$ からなる酸化膜あるいは $Fe_2O_3$ と $Cr_2O_3$ とからなる酸化膜とが形成させている部分が混在しているのが分かった。

#### (実施例2)

長さ1m、外径3/8インチのフェライト系ステンレス管(表1のA)2本を実施例1と同様にして電解研磨した後、Cr $_2$ O $_3$ の酸化不動態膜を形成した。

20 続いて、タングステンイナートガス溶接法により、バックシールガスとして、 Arに5ppmの酸素を含有させたガスを流しながら、配管の溶接を行った。

管を切断し、内表面に形成された酸化膜の深さ方向の組成分布をESCAで分析したところ、溶接部においても $Cr_2O_3$ を主成分とする酸化不動態膜が形成されていることが確認された。

25 オーステナイト系ステンレス管 (SUS316L) についても、比較例1の方法で電解研磨し、その後酸化不動態膜を形成し、溶接後の溶接部酸化膜の組成を調べたところ、酸化膜はFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を主成分とするものであることが分かった。

#### (実施例3)

電解質溶液のPHを種々の値に変えた以外は実施例1と同様にして電解研磨を

行い、表面を観察した。

PHが6より小さくするとあるいは10より大きくすると、平滑度にはそれほど影響はないが処理表面に微細なクラックのようなものが現れはじめ、PH6~8の範囲で特に表面状態の良好な処理ができることが分かった。

## 5 (実施例4)

実施例1と同様にして、1/4インチ径A1管の電解研磨を行った。なお、電解質溶液には、4.4mo1/1Na $_2$ SO $_4$ 溶液を $N_2$ ガスあるいは $N_2$ ガスに $H_2$ ガスを10%添加したガスでバブリングし溶存酸素を $N_2$ ガスあるいは $H_2$ ガスで置換した溶液を用いた。また、電圧20Vで電解研磨を行った。

超純水洗浄及び $N_2$ ガス乾燥後、管を切断し、表面観察及び平滑度の測定を行った。バブリングガスとして、 $N_2$ ガスを用いた場合及び $N_2$ ガスに $H_2$ ガスを10%添加したガスを用いた場合のいずれもRz=0.  $15\mu$ mと高い平滑性が得られたが、後者の場合( $N_2$ ガスに $H_2$ ガスを10%添加したガスを用いた場合)に比べて、前者の表面にわずかな白濁が観られた。

15

10

## 産業状の利用可能性

本発明の電解研磨法により、酸化し易い金属でも極めて平滑度の高い表面を形成することが可能となり、フェライト系ステンレス鋼に適用できるようになったため、溶接部も耐食性、脱ガス特性の高いCr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>からなる不動態膜を形成することが可能となる

20

#### 請求の範囲

- 1. PH6~10の電解質溶液であって、溶存する酸素を不活性ガスまたは水 素ガスで置換したことを特徴とする電解研磨用電解液。
- 5 2. 前記電解質は、NaNO $_3$ またはNa $_2$ SO $_4$ を含むことを特徴とする請求項 $_1$ に記載の電解研磨用電解液。
  - 3. 前記不活性ガスは窒素ガスであることを特徴とする請求項1または2に記載の電解研磨用電解液。
- 4. 請求項1~3のいずれか1項に記載の電解研磨用電解液を用いて、金属を 10 電解研磨することを特徴とする電解研磨法。
  - 5. 前記金属は、フェライト系ステンレス鋼またはAl (またはAl合金)であることを特徴とする請求項4に記載の電解研磨法。
  - 6. 不活性ガスの雰囲気中で行うことを特徴とする請求項5に記載の電解研磨 法。

15

20

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP95/01957

A 67 45	SIFICATION OF SUBJECT MATTER				
	Int. C1 <sup>6</sup> C25F3/16, C25F3/20, C25F3/24				
Int.	International Patent Classification (IPC) or to both nat	tional classification and IPC			
	DS SEARCHED				
B. FIELI	cumentation searched (classification system followed by cla	assification symbols)	1		
Int.	C16 C25F3/16, C25F3/20, C25	F3/24	j		
			fields searched		
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1995  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1995  Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1995				
Electronic da	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	JP, 41-14364, Bl (Ancat Englangust 11, 1966 (11. 08. 66) Lines 30 to 46, left column (Family: none)	),	16		
Y	JP, 1-109024, A (Inoue Japax Research Inc.), April 26, 1989 (26. 04. 89), Line 20, lower left column to line 8, lower right column, page 2 (Family: none)		1-6		
A -	JP, 1-165781, A (Kurita Water Industries Ltd.), June 29, 1989 (29. 06. 89), Lines 8 to 15, upper right column, page 3 (Family: none)		16		
A	JP, 59-107027, A (Kawasaki June 21, 1984 (21. 06. 84), Lines 5 to 14, lower left of (Family: none)		5, 6		
Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.  "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance the principle or theory underlying the invention cannot considered accument but published on or after the international filling date.  "E" earlier document but published on or after the international filling date.  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone.					
cited specia	cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means				
"P" docum	and a second second filling date but later than				
	eactual completion of the international search ember 8, 1995 (08. 12. 95)	Date of mailing of the international search report  December 26, 1995 (26. 12. 95)			
Name and	mailing address of the ISA/	Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Facsimile	No	Telephone No.			

	国際調査報告	El/Richard 9	
. 発明の異	する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. O.C. O.25 F3/	16.025F3/20.025F3/	2 4
、調査を行	った分野 小根資料(国際特許分類(IPC))		
査を行った数	Int. O.2. 025F3/	16.025F3/20.025F3/	2 4
	の實料で開発を行った分型に含まれるもの 日本国英用新案公報 日本国公開実用新案公報 日本国登録実用新案公報	400 64	
	月した電子データベース(データベースの名	8称、調査に使用した用語)	
C. 関連す	ると認められる文献		
 引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の簡例	<b>折が関連するときは、その関連する箇所の表示</b>	関連する 請求の範囲の番号
Y	コムパニー), 11.8月,1966(11 第3頁、左欄30行ー4	16行(ファミリー4し)	
Y	1 - 4 3 1000 (7)	- 右下欄 8 行 ( ファミリーなじ)	
Cmos	免さにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する	
* 引用文化	状のカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を な歴ではなる人、一般的技術水準を	「V」鉄に関連のある文献であって	の原理又は理論の程序のた
「L」優先 若理 「O」口頭 「P」関際	X版(は800分、とは 権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の くは他の特別な理由を確立するために引用で 由を付す) による開示、使用、展示等に言及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となっ に公妻された文献	「Y」特に関連のある文献であって 献との、当業者にとって自明	、当該文献と他の!以上の である組合せによって進歩
「L」優先 若し (理 「O」ロ頭 「P」国際 の後	くは他の特別な理由を確立するために利用。 由を付す) による開示、使用、展示等に言及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となっ	「ソ」特に関連のある文献であって 解との、当業者にとって自明 がないと考えられるもの	、当該文献と他の I 以上の である組合せによって違歩

C (義含) 、 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー#	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
A	JP, 1-165781, A(栗田工業株式会社), 29.6月, 1989(29, 06, 89), 第3頁、右上編8行-15行 (ファミリーなし)	1-6			
A	JP, 59-107027, A(川崎製鉄株式会社), 21.6月.1984(21.06.84), 第1頁、左下棚5行-14行 (ファミリーなし)	5,6			
:					